

# フォトニック結晶技術による 複屈折評価システム

株式会社 フォトニックラティス

## 複屈折／位相差測定を、一つ上の次元へ

複屈折/位相差の管理は、光学部品にとどまらず近年ますますその重要性を増しています。例えば、成型時に発生する応力分布を、複屈折分布で評価することにより、シミュレーションと実物の結果を比較することができます。

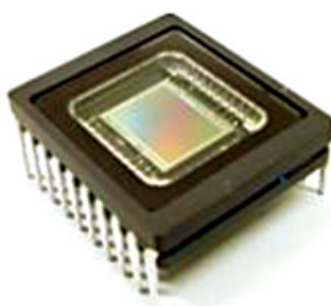
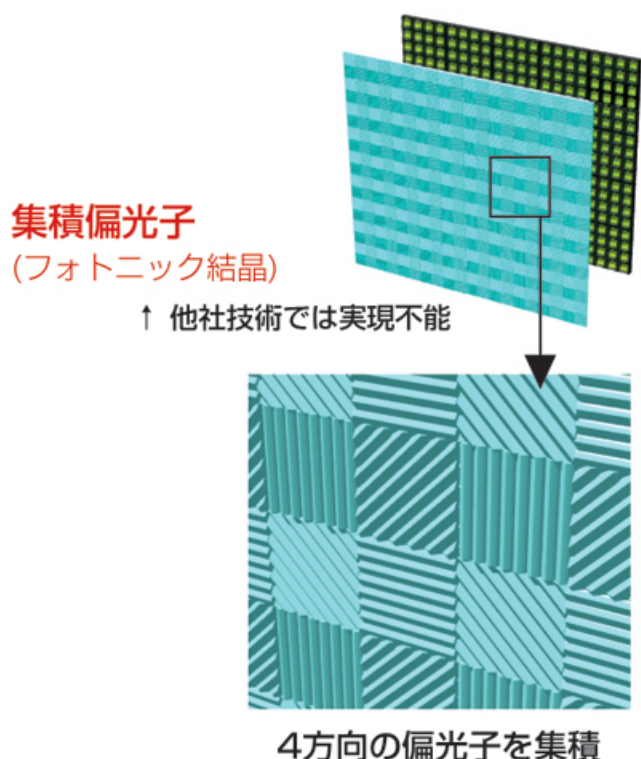
また、複屈折の低減が、光学レンズの解像度向上に不可欠なことが近年知られています。従来技術では、一点ずつを時間を掛けて測定していました。当社独自の偏光センサーは、高速な面分布測定を可能にしました。



偏光フィルターを回す代わりに敷き詰めることで、高速化、面測定、低価格化を実現しました

- 回転機構無しで瞬時に計測
- 面分布データを一括測定

● 偏光イメージセンサの構成概略図



通常のCCDサイズに  
数10万個分の偏光センサーが集積！

